21 微粒子操作技術の基礎的検討

縄稚典生,玉井正弘

Study on Control of Microparticles for Developing Microfluidic Devices

NAWACHI Norio and TAMAI Masahiro

This paper presents the development and experimental verification of control technique of microparticles. The methods utilizing hydrophobic and hydrophilic property, and dielectrophoresis (DEP) were investigated. In particular, the DEP microelectrode was fabricated by micro-electromechanical systems (MEMS) technology, the behavior and mobility of DEP were observed by an optical microscope.

キーワード: 微細加工, フォトリソグラフィ, エッチング, 誘電泳動

1 緒 言

近年, µ TAS (Micro Total Analysis System)と呼ば れる微小化学分析システムが盛んに研究されている 1)~3)。 µTASは、一般に半導体加工技術をベースとした MEMS (Micro Electro Mechanical Systems: 微小電気機械シ ステム)技術により作製され,微細な流路や混合器など 分析や合成に必要な機能をおよそ 10 数ミリのチップ上 に集約することができる。従来の分析装置と比べて,装 置を小型化できるだけでなく,試薬の低減や分析時間の 短縮といった利点も有しているため,分析化学から DNA チップなどバイオ分野に適用範囲も広がってきている。 中でも細胞工学においては,細胞を自在に操作する技術 が従来から求められており,微小粒子及び流体を取り扱 えるµTAS の活用が非常に有望視されている。そこで, 本研究では細胞や微生物などを操作する技術を見出すこ とを目的に,微粒子操作技術について基礎的研究を行っ たので報告する。

2 実験方法

本研究では,微粒子操作を2.1 個別分離,サイズなど 性質による2.2 群分離の観点から手法を検討した。

2.1 個別分離(疎水/親水面による検討)

疎水/親水面を利用した分離の概念図を図1に示す。ま ず,同一基板上に疎水,親水性の膜を混在させた試料を 作製する。液体中に分散した微粒子を溶液とし,試料を 溶液内に浸した後,引き上げる。この時,疎水/親水面の パターンサイズに応じた液滴が形成できれば,液滴内に 内包された微粒子を獲得できるというイメージである。 本研究では,液体に超純水を用い,基板表面の材質には, 疎水面にシリコン(Si),レジスト(感光剤)を,親水 面にはシリコン酸化膜(SiO₂),パイレックスガラスを 使用した。また,疎水/親水面の平面形状(パターン)の 効果についてもあわせて検討した。設計したパターンを 図2に示す。パターンは,疎水,親水面が交互になるよ うに配置した。具体的には,単位区画 300µm の領域 とその周辺を約30µm幅で囲んだパターンBと300µm を2分割したパターンAの2種類設計し,フォトリソ グラフィ技術を用いてアレイ化した。



図1 疎水/親水面を用いた分離のイメージ



2.2 群分離(誘電泳動法による検討)

微粒子の分離には、これまで電気泳動法が一般的に用 いられてきた。しかし、この方法は微粒子の電荷を利用 しているため、電気的中性の粒子を分離するには不向き であり、また直流を印加するため溶媒が電気分解する恐 れがあるなどの問題があった。そこで、本研究では、新 規な手法として最近注目されている誘電泳動法による分 離を検討した。誘電泳動とは、不均一な電場内にさらさ れた微粒子に誘起された双極子と電場との相互作用によ り微粒子に力が働く現象のことである。誘電泳動力は、 電場の2乗に比例し、粒子の誘電率が溶媒の誘電率より も大きい場合、粒子は電場の強い方向に引き寄せられ(正 の誘電泳動)、逆に粒子の誘電率が小さい場合には、粒 子は電場の弱い方向に引かれる(負の誘電泳動)⁴⁾⁻⁷。

分離に使用する電極は,高効率の誘電泳動力が期待で きる2組の対向電極とし,電極ギャップは,75µmとし た^{4),5)}。電極は,MEMS技術により作製した。電極の形 状を図3に,作製プロセスを図4に示す。



電極材質:C r/A u

電極ギャップ:75 µm

(a)電極パターン (b)電極(拡大)図3 誘電泳動用電極



図4 作製プロセスの概略



(a)作製した対向電極(b)観察状況図5 誘電泳動法による実験

表 1 実験条件		
微粒子	イースト菌 ポリスチレンビーズ	
溶液	重曹(N a H C O ₃)水溶液	
電場 印加電圧 周波数	1 V rms 100 H z ~ 1 M H z	

基板には 20×20mmのパイレックスガラスを使用し, 電極の材質は,クロム(Cr)/金(Au)の2層膜とした。微粒 子にはイースト菌(約5~7µm),ポリスチレンビーズ (20µm)を用い,交流電圧の印加には,ファンクシ ョンジェネレータを,微粒子の挙動は,光学顕微鏡を通 してデジタルカメラで取り込み,静止画,動画から解析 を行った。観察の様子を図5に,実験条件を表1に示す。

3 実験結果

3.1 個別分離(疎水/親水面による検討)

各々の材質に超純水を微量滴下した時の接触角を表2 に示す。

レジスト、Siの接触角には、大きな差はなく57°,51° であった。SiO2の接触角は49°と比較的大きな値であっ た。これは,油成分等が表面に残っていたことが原因と 考えられる。パイレックスガラスは,30°と他の3種類 の材質に比べて高い親水性を示した。次に,同一基板上 に,2種類の異なる材質を形成し(レジスト/SiO2,レジ スト/Si,レジスト/パイレックスの組み合わせで3試料), 表面に超純水を滴下した際の水滴の停留位置を観察した。 その結果の一例を図6に示す。3試料ともレジストの位

表2 各種材質の接触角

No.	膜面	接触角(°)
1	レジスト	5 7
2	Si	5 1
3	SiO ₂	4 9
4	パイレックス	30

置に水滴が集まる結果となった。



(a)レジスト面上の水滴 (b)レジスト/Si 上の水滴図6 疎水/親水面上の水滴形状の一例

そこで,最も水滴が明確に分離したレジスト/Siを材質 に用い,図2に示したパターン(A,B)による分離効果 について調べた。試料は,内側(図2白地部)をSi,外 側(図2斜線部)をレジストとした試料 , と内側を レジスト,外側をSiとした試料 , の4種類を準備し た。水滴を観察した結果を図7に示す。

試料 と および試料 と の比較から,特にパター ンが水滴形状に及ぼす影響は見られなかった。しかしな がら,周辺をレジストで囲んだ試料 , は,試料 ,

と比べ,水滴は四角に近い形状となっていることが見 受けられた。また,顕微鏡の観察結果から,水滴はレジ スト部で止まっていることが確認された(図8)。この ことから,水滴形状の制御には,レジストが有効である といえる。



図7 パターン上に滴下された水滴の様子



3.2 群分離(誘電泳動法による検討)

電圧 V=1Vrms を印加した時の微粒子の挙動の一例を 図9に示す。イースト菌は,f=1kHzでは,電極側に(正 の誘電泳動)移動し,f=500kHz では電極と反対側(負 の誘電泳動)に移動する様子が観察された。一方,ポリ スチレンビーズは,f=100Hz~1MHz の範囲では,負の 誘電泳動のみを示した。このことから,ポリスチレンビ ーズの誘電率は,溶媒の誘電率よりも小さいことが考え られる。また,ポリスチレンビーズに関して,印加周波 数と泳動速度の関係を図10に示す。図10から泳動速度 は周波数に比例して高くなる結果となった。

4 結 言

細胞や微生物を自在に操作する技術の開発を目的に, 微粒子操作技術の基礎的検討を行った。その結果,以下 の諸点が得られた。



図9 誘電泳動法による挙動の観察



図 10 印加周波数とポ リスチルビース の 泳動速度の関係 (1)個別分離(疎水/親水面による検討)

- ·Si, SiO₂, パイレックスガラスよりもレジストに水滴 が集まった。
- ・水滴形状の制御には、レジストが有効であることがわかった。
- (2)群分離(誘電泳動法による検討)
- ・イースト菌は *f*=1 kHz では正の誘電泳動を *f*=500kHz
 では負の誘電泳動をする様子が観察された。
- ・ポリスチレンビーズは,f=100Hz~1MHzの範囲では, 負の誘電泳動のみを示した。
- ・ポリスチレンビーズの泳動速度は,周波数に比例して 高くなることがわかった。

文 献

- 1)金田,藤井:表面技術,54(2003)6,11
- 2) 北森,金:マテリアルインテグレーション,(2002)11, 860
- 3)佐藤,鈴木: Chemical Sensors, 20(2004), 82
- 4)池田,塚原,文殊四郎,渡會:分析化学,51(2002)9, 767
- 5) I.Ikeda, S.Tsukahara, and H.Watarai
 :
Anal. Scien. $\ , \ 19(2003)1$, 27
- 6)尾形 高橋 安川 小谷松 西澤 未永: Chemical Sensors, 18(2002), 190
- 7)I.Doh, K.Seo and Y.Cho : IEEE Micro Electro Mechanical Systems , (2004) , 29